

筑波大学②

光散乱体の光学的測定方法、光学的測定装置

発明者：数理物質系 星野鉄哉 研究員、他。

特許番号：第6183826号、特願2016-204385

想定装置：微粒子の 3 次元形状計測装置（シリコンウェハ上のパーティクル検査）

発明内容

- ・光源波長の等倍～数十倍のサイズを有する微粒子（10nm～）に光を照射して分析する光計測システム。
- ・照射する光の集光スポットを微粒子の表面位置に合うように調整し、その散乱光の情報から微粒子の 3 次元形状および成分を推定することを特徴とする。
- ・単一の微粒子のみを選択的かつ定量的に非破壊・非接触で高速分析可能。
- ・多様な形状の微粒子を計測可能（形状種類に制限が少ない）

